【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成17年6月9日(2005.6.9)

【公開番号】特開2003-179109(P2003-179109A)
【公開日】平成15年6月27日(2003.6.27)
【出願番号】特願2001-379377(P2001-379377)
【国際特許分類第７版】
　Ｈ０１Ｌ　21/66
　Ｇ０１Ｒ　 1/06
　Ｇ０１Ｒ　31/26
　Ｈ０１Ｌ　21/68
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｌ　21/66　　Ｂ
　Ｇ０１Ｒ　 1/06　　Ｅ
　Ｇ０１Ｒ　31/26　　Ｊ
　Ｇ０１Ｒ　31/26　　Ｚ
　Ｈ０１Ｌ　21/68　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成16年9月3日(2004.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　被検査体の搬送機構を有するローダ室と、このローダ室と隔壁の開口部を介して連通し且つ上記被検査体の電気的特性検査を行うプローバ室とを備え、検査時には上記開口部を介して上記被検査体を搬送するプローブ装置において、上記ローダ室内で上記搬送機構を遮蔽する遮蔽体と、この遮蔽体内及び上記プローバ室内に乾燥気体を供給する手段とを備えたことを特徴とするプローブ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明の請求項２に記載のプローブ装置は、被検査体の搬送機構を有するローダ室と、このローダ室と隔壁の開口部を介して連通し且つ上記被検査体の電気的特性検査を行うプローバ室とを備え、検査時には上記開口部を介して上記被検査体を搬送するプローブ装置において、上記ローダ室内で上記搬送機構を遮蔽する遮蔽体と、この遮蔽体内及び上記プローバ室内に乾燥気体を供給する手段とを備えたことを特徴とするものである。